

開示の要約

研磨装置および研磨方法

- 5 ウェーハの状態変化を正確に検出することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、研磨面を有する研磨パッドを支持するための研磨テーブルと、ウェーハを研磨面に押し付けるための押圧面を有する回転可能なヘッド本体と、押圧面を囲むように配置され、かつヘッド本体と共に回転しながら研磨面を押し付けるためのリテーナリングと、リテーナリングと共に回転しない非回転部材と、リテーナリングと非回転部材の両方に接触している振動伝達部材と、非回転部材に固定されたセンサを備えている。
- 10

図 4